

國立屏東科技大學貴重儀器中心
電子顯微鏡實驗室
儀器設備及各項服務收費標準

101 年 04 月 26 日本校第 163 次行政會議通過

112 年 12 月 26 日 112 學年度第一次儀器管理委員會會議通過

儀器設備名稱	服務項目	單位	校內金額	校外金額	備註
掃描式電子顯微鏡(SEM) 型號：HITACHI S-3000N	SEM 上機觀察 EDS 元素分析	小時	400 元	<u>500 元</u>	
穿透式電子顯微鏡(TEM) 型號：HITACHI H-7500	TEM 上機觀察	小時	400 元	<u>500 元</u>	
離子覆膜機： 型號：HITACHI E-1010	離子覆膜(鍍金)	次	500 元	<u>600 元</u>	
臨界點乾燥機 型號：HITACHI HCP-2 型	臨界點乾燥	次	500 元	<u>600 元</u>	
超薄切片機 型號：LEICA ULTRACUT-R 型 玻璃製刀機 型號：LEICA KMR2 型	超薄切片機	小時	200 元	<u>200 元</u>	
	玻璃製刀機	小時	100 元	<u>100 元</u>	
	代切超薄切片	1 個樹脂塊	1000 元	<u>1200 元</u>	含銅網片及染色費用/2 片
	鍍碳銅網	片	80 元	<u>100 元</u>	
	TEM 樣品組織塊製作	件	1700 元	<u>2000 元</u>	含固定、脫水、包埋 (5 個樣品)
	SEM 樣品組織塊製作	件	1200	<u>1500 元</u>	含固定、脫水 (10 個樣品)

備註：收費標準以 1 小時為計次單位，未滿 1 小時以 1 小時計，必要時視維修或使用情形加以調整。

※本收費標準經儀器管理委員會會議通過後實施，修正時亦同。